Sächsischer Arbeitskreis **Elektronik-Technologie**

VDE / VDI

23. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI)

Donnerstag, 16. März 2000 10.00 Uhr am

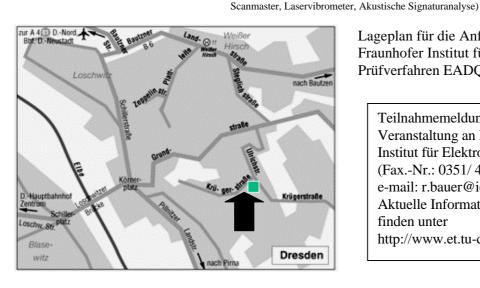
Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren EADO, beim

Krügerstr. 22, 01326 Dresden

Thema: Zerstörungsfreie Prüfung elektronischer Baugruppen und Werkstoffcharakterisierung

Leitung: Herr Dr. Baumbach, IZFP EADQ, Herr Prof. Sauer, TU Dresden

10:00 Uhr	Zerstörungsfreie Prüfverfahren – Das Methodenpotential des IZFP Herr Dr. Baumbach, IZFP EADQ
10:25 Uhr	Neue Inspektionsmöglichkeiten mit Röntgenverfahren Herr Dr. Baumbach, IZFP EADQ
10:50 Uhr	Pause
11:10 Uhr	Messung mechanischer Eigenspannungen in Schichten Herr Prof. Schreiber, IZFP EADQ
11:35 Uhr	Sensoren und Signalverarbeitung für zerstörungsfreie Prüfungen Herr Dr. Hönig, Herr Dr. Hentschel, IZFP EADQ
12:00 Uhr	Mittagspause (individuelles Mittagessen in der Gaststätte "Zur Eule" (ca. 10 min Fußweg))
13:15 Uhr	Ultraschall- und Röntgenmikroskopie zur Qualitätsbewertung in der Baugruppentechnologie Herr Dr. Herenz, Herr DiplIng. Daniel, Herr Prof. Wolter, TU Dresden
13:40 Uhr	Intelligente Kameras in der Elektronikproduktion Herr Dr. Kaiser, Dr. Kaiser Vision + Software GmbH, Dresden
14:05 Uhr	Praktische Erfahrungen zur zerstörungsfreien Prüfung in der Flachbaugruppenfertigung Herr DiplIng. Zschiedrich, Prettl Elektronik Radeberg GmbH
14:30 Uhr	EU-Förderung für Forschung und technologische Entwicklung Herr DiplMath. Rehm, BTI mbH Dresden
14:55 Uhr	aktuelle Informationen
15:15 Uhr	Laborbesichtigung (Rasterkraftmikroskop, Feinstrahlionenanlage, Wärmewellenmikroskop,



Lageplan für die Anfahrt Fraunhofer Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren EADQ

Teilnahmemeldungen sind bis eine Woche vor der

Veranstaltung an Herrn Dr. R. Bauer, TU Dresden, Institut für Elektronik-Technologie erbeten (Fax.-Nr.: 0351/463 7069 oder e-mail: r.bauer@iet.et.tu-dresden.de). Aktuelle Informationen sind auch im Internet zu finden unter

http://www.et.tu-dresden.de/iet/iet.html.

Laborbesichtigung

Rasterkraftmikroskop: Oberflächenabbildung mit atomarer Auflösung Feinstrahlionenanlage: Waferfeinbearbeitung und -untersuchung Wärmewellenmikroskop: Defektnachweis durch IR-Absorption

Scanmaster: Automatisierte Ultraschallprüfung

Laservibrometer: Berührungslose Schwingungsmessung Akustische Signaturanalyse: Automatische Produktprüfung